

導入年度	H 1 4 年度	設備名	精密レーザ測長システム			
メーカー	レニショー社 (英)	型 式	ML 1 0	設置室	精密測定室	

《 概 要 》

レーザ光の波長を基準とする波長干渉測長によって、NC工作機械や三次元測定機の検査、校正を行う測定機です。本装置では、位置決め精度や振動変位を高精度に測定することができます。

《 原 理 》

周波数安定型 He-Ne レーザ光によるドップラー効果と干渉を利用した測定方法によって、高分解能での移動量測定を行えます。

《 装置外観 》



《 仕 様 》

- ・分解能 : 1 nm
- ・測定精度 : ± 1.1 ppm
- ・位置決め測定範囲 : 0~40 m
- ・追従速度 : 60 m/min